

パーカー・ハネフィン日本 ガス発生装置

～もう、ガスボンベは要らない！安全・コストダウンの各種分析を可能にします～

G C分析用超高純度水素ガス発生装置

発生水素ガス純度 99.9995～99.99999%以上

水素ガスボンベ不要、電解液不要

F I Dに最適な燃焼ガスを最大 14 台分供給可能

長時間の動作が可能、色表示により確認作業が容易、イーザーメンテナンス

コンパクトで実験台に直接置けるベンチトップ型

研究用／C S A，U L，c U L、C E マークの認定済み

- 高純度水素ガス発生装置：H 2 P E M-100, 165, 260, 510 シリーズ
- 超高純度水素ガス発生装置：H 2 P D150 J A-100、H 2 P D300 J A-100
(アルカリ電解液仕様)
- 大容量超高純度水素ガス発生装置：H 2 -500 J A-100、H 2 -1200 J A-100
(パラジウム純化装置仕様)

分析装置用窒素ガス発生装置

発生窒素ガス純度 99.9999%

窒素ガスボンベ不要

コンパクトで実験台に直接置けるベンチトップ型

- 高純度窒素ガス発生装置：7 6 - 9 7 J A-1 0 0、7 6 - 9 8 J A-1 0 0
- P S A式高純度窒素ガス発生装置：H P N 2-1 1 0 0 J A-1 0 0 (旧 76-92)
U H P N 2-1 1 0 0 J A-1 0 0 (旧 76-94)
- メンブレン窒素ガス発生装置：N 2-1 4 (旧：7 5-7 2)
N 2-1 4 A J A-1 0 0 (旧：7 5-7 2 0 J A-1 0 0)
N 2-2 2 (旧：7 5-7 4)
N 2-2 2 J A-1 0 0 (旧：7 5-A 7 4 0 J A-1 0 0)
N 2-4 5 (旧：N 2-2 0 1 0)
N 2-4 5 A (旧：N 2-2 0 1 0-0 2 J A-100)
N 2-8 0 (旧：7 5-8 8 0)

高純度水素ガス発生装置



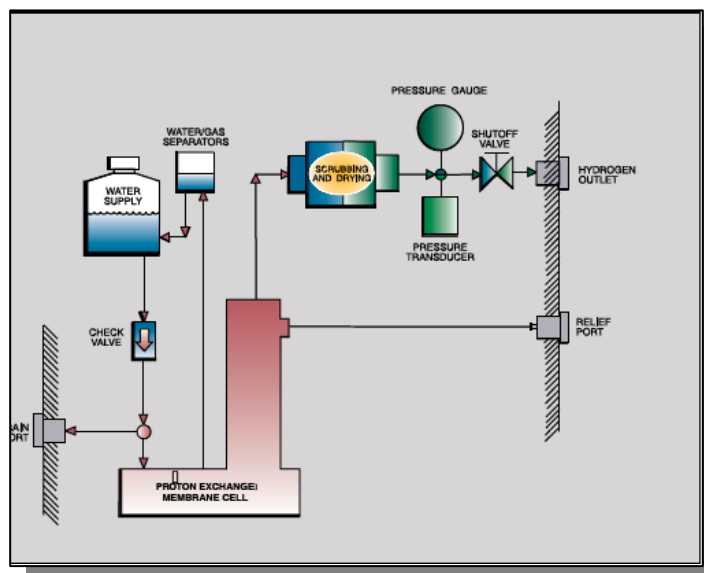
ENGINEERING YOUR SUCCESS.

高純度水素ガス発生装置

H2PEM-100・H2PEM-165・H2PEM-260・H2PEM-510 シリーズ

特徴

<フローシート>



- ・FIDに最適な燃焼ガスを最大14台分供給可能です。
- ・危険で高価な水素ボンベが不要になります。
- ・先進的な純粋管理システムと制御回路により長時間の動作が可能。
- ・運転状況を照明の色で表示、水位の確認・動作状況を簡単に確認できます。
- ・USB 接続により、動作状況のモニタリング及び、リモートコントロールが可能です。
- ・研究用として、CSA/UL/cUL/CE マークの認定を受けています。
- ・信頼性が高くコンパクト、ベンチ上の所要面積はわずか0.09 m²です。
- ・電解液は不要です。

製品型式	H2PEM-100	H2PEM-165	H2PEM-260	H2PEM-510
発生ガス純度	99.9995%以上			
純水貯蔵量	4リットル			
最大流量	100cc/min	165cc/min	260cc/min	510cc/min
出口圧力	0.07 ~ 0.69Mpa			
電源	AC100~230V/50~60Hz			
外形寸法(H×W×D)	43.5cm×34.2cm×45.6cm			
乾燥重量	18kg			
出口ジョイント	1/8"チューブ継手			
交換部品	型番		交換頻度	
デシカントカートリッジ	MKH2PEM-D		必要により実施	
サービスキット A	MKH2PEM-6M		6ヶ月(4000時間)毎	
サービスキット B	MKH2PEM-24M		24ヶ月(16000時間)毎	

* 但し、製品仕様は予告なく変更される場合があります。



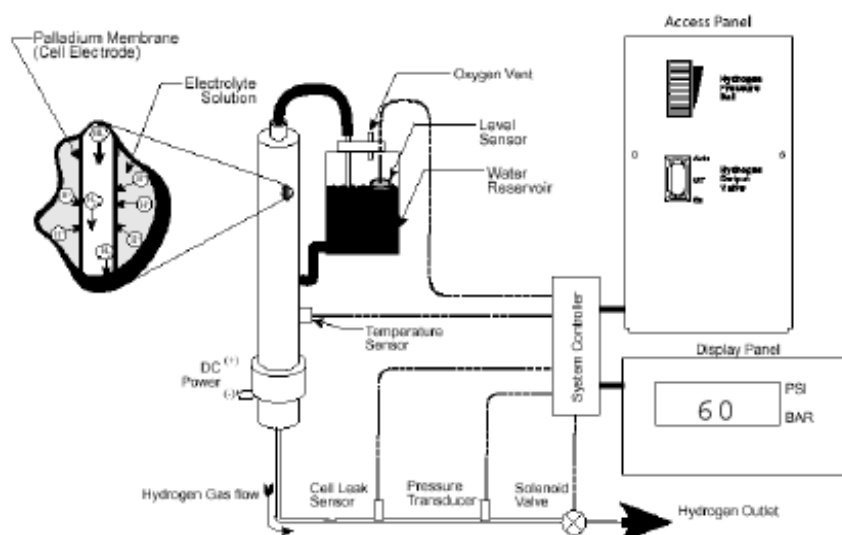
ENGINEERING YOUR SUCCESS.

超高純度水素ガス発生装置(アルカリ電解液仕様) H2PD150・H2PD300 シリーズ

特徴



<フローシート>



- ・純度99.99999%以上、突出圧力 (4.2kg/cm²G)
- ・最大ガス流量: H2PD150 = 150 ml/min H2PD300 = 300 ml/min
- ・電解セルにパラジウムを使用しているため、ピュアでドライな水素ガスを発生させることができます。
- ・液晶ディスプレイ表示で操作も簡単。実験台に直接置けるベンチトップ型。
- ・装置内部での貯蔵水素ガスはどの圧力でも 50 ml 以下。ユーザーメンテナンス可能です。

製品型式	H2PD150JA-100	H2PD300JA-100
生成ガス(水素) 純度	99.99999%以上	
最大水素流量	150ml/min	300ml/min
酸素含有率	< 0.01ppm	
水分含有量	< 1.0ppm	
排出圧力MpaG(Kg/cm ² G)	0~0.4 (4.2)	
使用する純水	5MΩ以上のイオン交換水	
電源	AC100V 3.15A	
外形寸法(W×D×H)	30cm×33cm×58cm	
乾燥重量	26.0kg	
出口ジョイント	1/8" チューブ継手	
交換部品	型番	交換頻度
電解液	920071	1年毎

* 但し、製品仕様は予告なく変更される場合があります。



ENGINEERING YOUR SUCCESS.

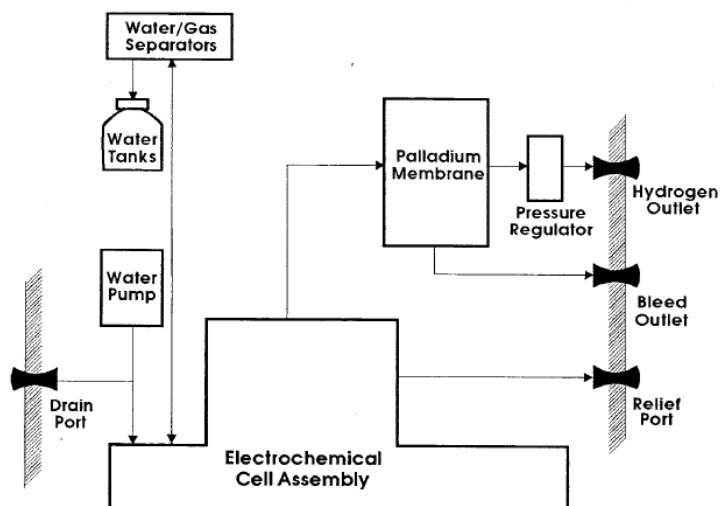
大容量超高純度水素ガス発生装置(パラジウム純化装置仕様) H2-500・H2-1200 シリーズ

特徴



写真はH2-1200型です。

<フローシート>



- ・安定した水素ガスを発生させるSPE (固体ポリマー電解膜)方式と高純度に純化させるパラジウムメンブレンの技術を融合し、超高純度の水素ガスの大量・安定供給を実現します。
- ・水素ガス純度 99.9999%以上。イオン交換水のための補充。シリカゲル等の乾燥剤は不要。
- ・貯蔵水素ガスは0.97MpaG(9.8kg/cm²G)条件下において 100ml。
- ・見やすい液晶ディスプレイで操作も簡単。オプションの自動イオン交換水補充機を取り付けますとイオン交換水を補充する手間が省けます。

製品型式	H2-500JA-100	H2-1200JA-100
生成ガス(水素)純度	99.9999%以上	
最大水素流量	500ml/min	1200ml/min
酸素含有率	< 0.01ppm	
水分含有量	< 1.0ppm	
排出圧力MpaG(Kg/cm ² G)	0.62	0.69
使用する純水	5MΩ以上のイオン交換水	
電源	AC100V 6.0A	
外形寸法(W×D×H)	38cm×43cm×33cm	33cm×40.6cm×37.8cm
乾燥重量	26.0kg	
出口ジョイント	1/8" チューブ継手	1/4" チューブ継手



ENGINEERING YOUR SUCCESS.